PACS 42.55.Px; 72.20.Jv; 32.50 + d

# Спонтанная излучательная рекомбинация и безызлучательная оже-рекомбинация в квантоворазмерных гетероструктурах

Л.В.Асрян

Рассмотрен общий подход к описанию параметров спонтанной излучательной и безызлучательной оже-рекомбинаций (скоростей, потоков и плотностей токов) в гетероструктурных лазерах с различными типами квантоворазмерной активной области (квантовые ямы, квантовые проволоки и квантовые точки). Обсуждаются корректный способ определения коэффициентов спонтанной излучательной и безызлучательной оже-рекомбинаций и их размерности. Показано, что только в квантовой точке могут быть введены истинные временные константы для спонтанной излучательной и безызлучательной оже-рекомбинаций, которые не зависят от уровня инжекции. Приведены изящные аналитические выражения для коэффициента излучательной рекомбинации в виде явной зависимости от температуры и параметров для объёмной и квантоворазмерных структур. Эти выражения ясно демонстрируют неприемлемость распространённой практики определения коэффициентов рекомбинаций в низкоразмерных гетероструктурах из их объёмных значений.

**Ключевые слова**: спонтанная излучательная рекомбинация, безызлучательная оже-рекомбинация, полупроводниковые лазеры, гетероструктуры, квантовые ямы, квантовые проволоки, квантовые точки.

## 1. Введение

Квантовые ямы (КЯ) широко используются в качестве активной области одного из основных приборов оптоэлектроники — диодного лазера [1-4]. Как было предсказано в [5,6] и далее успешно продемонстрировано, например, в [7-9], использование гетероструктур ещё более низкой размерности, таких как квантовые проволоки (КП) [10] и в особенности квантовые точки (КТ) [11], может существенно улучшить рабочие характеристики полупроводниковых лазеров.

Функционирование полупроводникового лазера в значительной степени определяется рекомбинационными процессами в структуре. Интенсивность каждого из рекомбинационных процессов характеризуется своей скоростью. В данной работе обсуждаются два таких процесса — спонтанная излучательная рекомбинация и безызлучательная оже-рекомбинация.

Важными параметрами, описывающими скорости рекомбинационных процессов, являются коэффициент спонтанной излучательной рекомбинации (излучательная постоянная) B и коэффициент безызлучательной оже-рекомбинации (оже-постоянная) C. Несмотря на то что низкоразмерные лазерные структуры интенсивно изучаются, для получения коэффициентов B и C в настоящее время широко практикуется использование объёмных коэффициентов  $B_{3D}$  и  $C_{3D}$ . Такой подход подразумевает (часто в неявном виде), что эти коэффициенты масштабно изменяются (скейлингуются) с изменением размера квантоворазмерной области (см. ниже). Недо-

L.V.Asryan. Virginia Polytechnic Institute and State University, Blacksburg, Virginia 24061, USA; e-mail: asryan@mse.vt.edu, http://www.mse.vt.edu/people/faculty/asryan.html

Поступила в редакцию 23 августа 2005 г.

статки такого подхода впервые детально обсуждались в работе [12], в которой в рамках общего подхода в явном виде был сформулирован физически адекватный способ представления скоростей рекомбинации в КЯ.

В настоящей работе с целью построения общей картины будут представлены выражения для скоростей, потоков и плотностей токов спонтанной излучательной и безызлучательной оже-рекомбинаций во всех типах низкоразмерных гетероструктур (КЯ, КП и КТ), используемых в инжекционных лазерах в качестве активных областей. Для сравнения будут представлены также соответствующие выражения для объёмной активной области.

# 2. Основные уравнения

## 2.1. Объёмная активная область

В трёхмерной (3D) области адекватными величинами являются скорости спонтанной излучательной и безызлучательной оже-рекомбинаций в единице объёма

$$R_{\rm spon}^{\rm 3D} = B_{\rm 3D} n_{\rm 3D} p_{\rm 3D},\tag{1}$$

$$R_{\text{Auger}}^{3D} = C_{3D} n_{3D}^2 p_{3D} \tag{2}$$

с размерностью  $[L]^{-3}[T]^{-1}$ .

Произведение трёхмерных концентраций электронов и дырок в уравнении (1)  $n_{\rm 3D}p_{\rm 3D}$  (каждая из которых измеряется в см $^{-3}$ ) отражает тот факт, что спонтанная излучательная рекомбинация является бимолекулярным процессом, т. е. в каждом элементарном акте рекомбинации участвуют два носителя — электрон и дырка.

Произведение  $n_{\rm 3D}^2 p_{\rm 3D}$  в уравнении (2) отражает тот факт, что оже-рекомбинация является тримолекулярным процессом, т. е. в каждый элементарный акт рекомбинации вовлечены три носителя — два электрона и дырка (в частном случае рассматриваемого здесь для определён-

Табл.1.

ности СНСС-процесса [13]); С обозначает зону проводимости (conduction band), H – зону тяжёлых дырок (heavyhole valence band). Могут иметь место также другие ожепроцессы, например СННЅ-процесс (S обозначает спинотщеплённую валентную зону (spin-split-off valence band)), для которых скорость рекомбинации пропорциональна  $n_{3D}p_{3D}^2$ , поскольку в каждый элементарный акт в этих процессах вовлечены электрон и две дырки.

этих процессах вовлечены электрон и две дырки. Если  $R_{\rm spon}^{\rm 3D}$  и  $R_{\rm Auger}^{\rm 3D}$  измеряются в см $^{-3}\cdot{\rm c}^{-1}$ , то  $B_{\rm 3D}$  и  $C_{\rm 3D}$  имеют размерности см $^{3}\cdot{\rm c}^{-1}$  и см $^{6}\cdot{\rm c}^{-1}$  соответственно

Наряду с самим током инжекции выжным параметром для диодных лазеров является плотность тока на единицу площади, перпендикулярной направлению инжекции. Плотность тока инжекции измеряется в  $\mathbf{A} \cdot \mathbf{cm}^{-2}$  и является произведением заряда электрона и потока инжекции.

В процессах как спонтанной излучательной, так и безызлучательной оже-рекомбинации в диодных лазерах происходит «расходование» инжектированных носителей. Таким образом, определённая часть полного потока инжекции «уходит» на потоки этих рекомбинаций. Последние представляются в виде произведений линейного размера (толщины) b объёмной области рекомбинации в направлении тока инжекции и ее скоростей в единице объёма, даваемых уравнениями (1) и (2):

$$bR_{\rm spon}^{\rm 3D} = bB_{\rm 3D}n_{\rm 3D}p_{\rm 3D},\tag{3}$$

$$bR_{\text{Auger}}^{3\text{D}} = bC_{3\text{D}}n_{3\text{D}}^2p_{3\text{D}} \tag{4}$$

(размерность  $[L]^{-2}[T]^{-1}$ ). Плотности токов спонтанной излучательной и безызлучательной оже-рекомбинаций есть

$$j_{\text{spon}}^{3D} = ebR_{\text{spon}}^{3D} = ebB_{3D}n_{3D}p_{3D},$$
 (5)

$$j_{\text{Auger}}^{\text{3D}} = ebR_{\text{Auger}}^{\text{3D}} = ebC_{\text{3D}}n_{\text{3D}}^2p_{\text{3D}}.$$
 (6)

Выражение для  $B_{\rm 3D}$  в невырожденном объёмном материале приведено в табл.1.

#### 2.2. Квантовая яма

В двумерной (2D) гетероструктуре – квантовой яме – корректным является определение скоростей рекомбинаций в единице площади в плоскости КЯ:

$$R_{\rm spon}^{\rm 2D} = B_{\rm 2D} n_{\rm 2D} p_{\rm 2D},\tag{7}$$

$$R_{\text{Auger}}^{\text{2D}} = C_{\text{2D}} n_{\text{2D}}^2 p_{\text{2D}}$$
 (8)

(размерность  $[L]^{-2}[T]^{-1}$ ), где  $n_{\rm 2D}$  и  $p_{\rm 2D}$  – двумерные концентрации носителей, измеряемые в см $^{-2}$ . Если  $R_{\rm spon}^{\rm 2D}$  и  $R_{\rm Auger}^{\rm 2D}$  измерять в см $^{-2} \cdot {\rm c}^{-1}$ , то  $B_{\rm 2D}$  и  $C_{\rm 2D}$  будут иметь размерности см $^2 \cdot {\rm c}^{-1}$  и см $^4 \cdot {\rm c}^{-1}$  соответственно.

Выражение для  $B_{\rm 2D}$  в невырожденном двумерном материале (табл.1) было выведено с использованием матричного элемента межзонных оптических переходов в рамках  $k \cdot p$ -теории.

Уравнения (7) и (8) описывают также потоки рекомбинаций в одиночной КЯ.

Плотности токов рекомбинаций в структуре с множественными КЯ имеют вид

$$j_{\text{spon}}^{\text{2D}} = eN_{\text{QW}}B_{\text{2D}}n_{\text{2D}}p_{\text{2D}},\tag{9}$$

$$j_{\text{Auger}}^{\text{2D}} = eN_{\text{QW}}C_{\text{2D}}n_{\text{2D}}^{2}p_{\text{2D}},\tag{10}$$

где  $N_{\mathrm{OW}}$  – число КЯ.

## 2.3. Квантовая проволока

В одномерной (1D) гетероструктуре – квантовой проволоке – корректным является определение скоростей рекомбинаций на единицу длины КП:

Структура	Коэффициент спонтанной излучательной рекомбинации*,***	Размерность	Литература
Объёмная	$B_{ m 3D} = rac{4}{3} \sqrt{2} \pi^{3/2} lpha \sqrt{\epsilon} rac{\hbar^2}{[(m_{ m c} + m_{ m hh}) k_{ m B} T]^{3/2}} E_{ m g} \left(rac{P}{\hbar c} ight)^2$	$[L]^3[T]^{-1}$	[14]***
****	$B_{ m 2D} = rac{4}{3}\pilpha\sqrt{arepsilon}rac{\hbar}{(m_{ m c}+m_{ m hh})k_{ m B}T}E_0igg(rac{P}{\hbar c}igg)^2$	$[L]^2[T]^{-1}$	Настоящая работа (см. также [12], [15], [16])
КП****	$B_{\mathrm{1D}} = rac{2}{3}\sqrt{2\pi}lpha\sqrt{arepsilon}rac{1}{\left[(m_{\mathrm{c}}+m_{\mathrm{hh}})k_{\mathrm{B}}T ight]^{1/2}}E_{\mathrm{0}}igg(rac{P}{\hbar c}igg)^{2}$	$[L][T]^{-1}$	Настоящая работа
KT***	$B_{\rm 0D} = \frac{1}{1000} = \frac{8}{2} \alpha \sqrt{\varepsilon} \frac{E_0}{t_0} \left(\frac{P}{t_0}\right)^2$	$[T]^{-1}$	[14]

П р и м е ч а н и я :  $\alpha=e^2/\hbar c$  – постоянная тонкой структуры; e – заряд электрона;  $\hbar$  – постоянная Планка; c – скорость света в вакууме;  $\varepsilon$  – диэлектрическая постоянная;  $m_c$  и  $m_{\rm hh}$  – эффективные массы электрона и тяжёлой дырки;  $k_{\rm B}$  – постоянная Больцмана; T – температура;  $E_{\rm g}$  — ширина запрещённой зоны объёмного материала;  $E_0=E_{\rm g}+\varepsilon_n+\varepsilon_p$  – энергия оптического перехода;  $\varepsilon_n$  и  $\varepsilon_p$  – энергии низших уровней (краёв низших подзон) размерного квантования электрона и дырки в зоне проводимости и валентной зоне соответственно, отсчитанные от краёв этих зон; параметр Кейна P определяется из соотношения

$$P^{2} = \frac{\hbar}{2} \left( \frac{1}{m_{\rm c}} - \frac{1}{m_{\rm 0}} \right) \frac{E_{\rm g}(E_{\rm g} + \Delta_{\rm 0})}{E_{\rm g} + 2\Delta_{\rm 0}/3};$$

 $m_0$  — масса свободного электрона;  $\Delta_0$  — энергия спин-орбитального расщепления (использование параметра P удобно ввиду его слабой зависимости от типа материала [18]).

\*Как в зоне проводимости, так и в валентной зоне предполагаются наличие единственной подзоны и параболический закон дисперсии в направлении свободного движения. \*\*Отношение  $P/\hbar c$  является безразмерным. \*\*\*Для сравнения выражения для  $B_{3D}$  с таковыми для низкоразмерных структур уравнение (10) из работы [14] упрощено (учитываются только тяжёлые дырки). \*\*\*\*В отличие от ширины запрещённой зоны  $E_{\rm g}$  в выражении для  $B_{3D}$ , в выражения для B в квантоворазмерных структурах входит энергия  $E_{\rm 0}$  оптического перехода между краями низших подзон (низшими уровнями) в зоне проводимости и валентной зоне.

$$R_{\rm spon}^{\rm 1D} = B_{\rm 1D} n_{\rm 1D} p_{\rm 1D},\tag{11}$$

$$R_{\text{Auger}}^{1D} = C_{1D} n_{1D}^2 p_{1D} \tag{12}$$

(размерность  $[L]^{-1}[T]^{-1}$ ), где  $n_{1D}$  и  $p_{1D}$  – одномерные концентрации носителей, измеряемые в см $^{-1}$ . Если  $R_{\rm spon}^{\rm 1D}$  и  $R_{\rm Auger}^{\rm 1D}$  измерять в см $^{-1}$  сс $^{-1}$ , то  $B_{\rm 1D}$  и  $C_{\rm 1D}$  будут иметь размерности см $\cdot$ с $^{-1}$  и см $^2$ ·с $^{-1}$  соответственно.

Выражение для  $B_{1D}$  в невырожденном одномерном материале также приведено в табл.1. Подобно выражениям для излучательной постоянной в объёмной структуре и структурах с КЯ и КТ оно было выведено в рамках  $k \cdot p$ -теории.

Потоки рекомбинаций в одиночном слое с КП есть

$$N_{\rm lin}B_{\rm 1D}n_{\rm 1D}p_{\rm 1D},\tag{13}$$

$$N_{\rm lin}C_{\rm 1D}n_{\rm 1D}^2p_{\rm 1D},\tag{14}$$

где  $N_{\mathrm{lin}}$  – линейная концентрация КП в слое, измеряемая в см<sup>-1</sup> (см. [17]); размерность потоков  $[L]^{-2}[T]^{-1}$ .

Плотности токов рекомбинаций в структуре с множественными слоями с КП таковы:

$$j_{\text{spon}}^{\text{1D}} = eN_{\text{QWR-layer}}N_{\text{lin}}B_{\text{1D}}n_{\text{1D}}p_{\text{1D}}, \tag{15}$$

$$j_{\text{Auger}}^{\text{1D}} = eN_{\text{QWR-layer}}N_{\text{lin}}C_{\text{1D}}n_{\text{1D}}^2p_{\text{1D}},\tag{16}$$

где  $N_{
m OWR-laver}$  — число слоёв с КП.

#### 2.4. Квантовая точка

В нульмерной (0D) гетероструктуре – квантовой точке - корректным является определение скоростей рекомбинаций на одну КТ. Ввиду квантоворазмерного эффекта во всех трёх направлениях в КТ не существует объёма, площади или длины, по отношению к которым можно отсчитывать скорости переходов. В работе [14] для скорости спонтанной излучательной рекомбинации в КТ было получено следующее выражение:

$$R_{\text{spon}}^{\text{0D}} = B_{\text{0D}} f_n f_p = \frac{f_n f_p}{\tau_{\text{OD}}^{\text{spon}}},$$
(17)

где  $f_n$  и  $f_p$  – степени заполнения электронного и дырочного уровней (вероятности заполнения уровней) в КТ, которые являются аналогами концентраций носителей в объёмном материале, КЯ и КП;  $R_{\mathrm{spon}}^{\mathrm{0D}}$  измеряется в  $[T]^{-1}$ .

Скорость оже-рекомбинации в КТ может быть представлена следующим образом:

$$R_{\text{Auger}}^{0D} = C_{0D} f_n^2 f_p = \frac{f_n^2 f_p}{\tau_{\text{QD}}^{\text{Auger}}}$$
 (18)

(измеряется в  $[T]^{-1}$ ). Поскольку  $R_{\rm spon}^{\rm 0D}$  и  $R_{\rm Auger}^{\rm 0D}$  измеряются в  ${\rm c}^{-1}$ , а  $f_n$  и  $f_p$  являются безразмерными величинами, то  $B_{0D}$  и  $C_{0D}$  имеют размерность  $c^{-1}$ . Таким образом,  $B_{0\mathrm{D}}$  и  $C_{0\mathrm{D}}$  могут рассматриваться как величины, обратные временам спонтанной излучательной  $( au_{QD}^{spon})$  и оже- $( au_{QD}^{Auger})$  рекомбинаций:

$$B_{0D} = \frac{1}{\tau_{QD}^{\text{spon}}},$$

$$C_{0D} = \frac{1}{\tau_{QD}^{\text{Auger}}}.$$
(19)

$$C_{0D} = \frac{1}{\tau_{OD}^{\text{Auger}}}.$$
 (20)

Выражение для  $\emph{B}_{0\mathrm{D}}=1/ au_{\mathrm{QD}}^{\mathrm{spon}}$  приведено в табл.1.

Потоки рекомбинаций в одиночном слое с КТ

$$N_{\rm s}B_{\rm 0D}f_nf_p = N_{\rm s}\frac{f_nf_p}{\tau_{\rm OD}^{\rm spon}},\tag{21}$$

$$N_{\rm s}C_{\rm 0D}f_n^2f_p = N_{\rm s}\frac{f_n^2f_p}{\tau_{\rm OD}^{\rm Auger}};$$
 (22)

размерность потоков  $[L]^{-2}[T]^{-1}$ ,  $N_s$  – поверхностная концентрация КТ в слое (измеряется в  $cm^{-2}$ ).

Плотности токов рекомбинаций в структуре с множественными слоями с КТ

$$j_{\text{spon}}^{\text{0D}} = eN_{\text{QD-layer}}N_{\text{s}}B_{\text{0D}}f_{n}f_{p} = eN_{\text{QD-layer}}N_{\text{s}}\frac{f_{n}f_{p}}{\tau_{\text{QD}}^{\text{spon}}}, \quad (23)$$

$$j_{\text{Auger}}^{0D} = eN_{\text{QD-layer}}N_{\text{s}}C_{0D}f_{n}^{2}f_{p} = eN_{\text{QD-layer}}N_{\text{s}}\frac{f_{n}^{2}f_{p}}{\tau_{\text{QD}}^{\text{Auger}}}, (24)$$

где  $N_{
m OD-layer}$  – число слоёв с КТ.

## 3. Обсуждение

1. Из табл. 1 следует, что в общем случае коэффициент спонтанной излучательной рекомбинации является обратной степенной функцией от  $\sqrt{T}$ 

$$B_{r\rm D} \propto \frac{1}{T^{r/2}},\tag{25}$$

где r – размерность структуры (r = 3, 2, 1 и 0 в объёмном материале, КЯ, КП и КТ соответственно). Такая температурная зависимость является простым следствием температурной зависимости эффективных плотностей состояний в зоне проводимости и валентной зоне, которые в общем случае имеют вид

$$N_{\rm c,v}^{\rm rD} \propto T^{r/2}$$
. (26)

2. Сравнение вышеприведённых уравнений для различных низкоразмерных систем показывает, что только в квантовой точке могут быть введены истинные временные константы для спонтанной излучательной и оже-рекомбинаций,  $\tau_{\mathrm{QD}}^{\mathrm{spon}}$  и  $\tau_{\mathrm{QD}}^{\mathrm{Auger}}$ , которые не зависят от степеней заполнения уровней  $f_n$  и  $f_p$ , т. е. от тока инжекции (накачки), и, следовательно, являются истинными рекомбинационными временами жизни.

Тем не менее стало общепринятой практикой использовать времена спонтанной излучательной и оже-рекомбинаций как в объёмной структуре, так и в структурах с КЯ и КП. Определив

$$\frac{1}{\tau \operatorname{spon}} = Bn, \tag{27}$$

$$\frac{1}{\tau^{\text{Auger}}} = Cn^2,\tag{28}$$

для скоростей рекомбинации получим

$$R_{\rm spon} = \frac{p}{\sigma^{\rm spon}},\tag{29}$$

$$R_{\text{Auger}} = \frac{p}{A_{\text{Uger}}}.$$
 (30)

Как видно из уравнений (27) и (28),  $\tau^{\text{spon}}$  и  $\tau^{\text{Auger}}$  зависят от концентрации носителей (в данном случае, для определённости, концентрации электронов), т. е. от тока накачки, и, следовательно не являются истинными временными константами. Корректными величинами в объёмной структуре и структурах с КЯ и КП являются соответствующие коэффициенты рекомбинации B и C. В отличие от таких структур  $\tau_{\rm QD}^{\rm spon}$  и  $\tau_{\rm QD}^{\rm Auger}$  – истинные временные константы в КТ. Использование в КТ коэффициентов рекомбинации  $B_{\rm 0D}$  и  $C_{\rm 0D}$  эквивалентно использованию временных констант.

3. Плотности токов скейлингуются с изменением толщины b области только в случае объёмной области (уравнения (5), (6)). Для КЯ (уравнения (9), (10)), КП (уравнения (15) и (16)) и КТ (уравнения (23), (24)) j<sub>spon</sub> и j<sub>Auger</sub> не скейлингуются с изменением линейного размера (толщины КЯ, толщины слоя с КП или КТ). Это вполне естественно, поскольку размер всех этих низкоразмерных структур настолько мал, что проявляется квантоворазмерный эффект. КЯ, слой с КП и слой с КТ ведут себя как двумерный слой, т. е. слой, не имеющий толщины в поперечном направлении, что и позволяет рассматривать их в качестве квантоворазмерных. Размер структуры действительно оказывает влияние на энергии уровней размерного квантования и, следовательно, на энергию оптического перехода  $E_0$ , а значит, и на B (см. табл.1) и C, но такая зависимость от размера ни в коей мере не является скейлинговой.

4. Распространённая практика определения коэффициентов рекомбинаций в низкоразмерных структурах из объёмных значений приводит к сильной (скейлинговой) зависимости от размера области рекомбинации  $a^*$ . Это продемонстрировано в табл.2.

Точно так же, как концентрация носителей в квантоворазмерной гетероструктуре не может быть определена из объёмного значения (что, тем не менее, часто делается) и должна получаться независимым образом с использованием соответствующей плотности состояний, коэффициенты спонтанной излучательной и оже-рекомбинаций в квантоворазмерной гетероструктуре не могут быть определены из объёмных значений и должны вычисляться независимым образом. В табл.1 приведены корректные выражения для коэффициента спонтанной излучательной рекомбинации В в виде зависимости от температуры и параметров для объёмной и квантоворазмерных структур. Из этих выражений следует отсутствие какой-либо скейлинговой зависимости от размера и ясно видна полная неприемлемость в случае квантоворазмерных структур упрощённого подхода, основанного на использовании объёмных значений и проиллюстрированного в табл.2. Таким образом, как указано выше, реальная зависимость В от размера, связанная с аналогичной зависимостью энергии перехода  $E_0$  в низкоразмерных структурах, не является скейлинговой.

Табл.2. Коэффициенты спонтанной излучательной и безызлучательной оже-рекомбинаций низкоразмерных структур при использовании объемных значений  $B_{\rm 3D}$  и  $C_{\rm 3D}$ 

Коэффициенты	КЯ	КП	КТ
Коэффициент спонтанной излу- чательной рекомбинации	$\frac{B_{3D}}{a}$	$\frac{B_{3D}}{a^2}$	$\frac{B_{3D}}{a^3}$
Коэффициент безызлучательной оже-рекомбинации	$\frac{C_{3D}}{a^2}$	$\frac{C_{3D}}{a^4}$	$\frac{C_{3D}}{a^6}$

<sup>\*</sup>Другим недостатком общепринятой процедуры является тот факт, что размер области рекомбинации, т.е. размер области истинной локализации носителя, больше (часто значительно больше) геометрического размера квантоворазмерной области, определяемого её гетерограницами с окружающим материалом.

Тот же вывод справедлив и в отношении коэффициента оже-рекомбинации C в квантоворазмерных структурах. Расчёт оже-константы сложнее, чем расчёт излучательной константы, и обычно требует привлечения численных методов. В отличие от расчета для B, не существует аналитических выражений, которые давали бы приемлемые оценки для C. В дополнение к этому определение C из эксперимента представляет собой сложную задачу, вследствие чего известные из литературы значения C сильно различаются даже в объёмном материале [13].

## 4. Заключение

Описан общий подход к скоростям, потокам и плотностям токов спонтанной излучательной и безызлучательной оже-рекомбинаций в гетероструктурных лазерах с квантоворазмерной активной областью (содержащей квантовые ямы, проволоки или точки). Показано, что только в гетероструктуре с квантовой точкой могут быть введены истинные временные константы для спонтанной излучательной и безызлучательной оже-рекомбинаций, которые не зависят от уровня инжекции. Приведены аналитические выражения для коэффициента излучательной рекомбинации в виде явной функции от температуры и параметров объёмной и квантоворазмерных структур. Эти выражения ясно показывают неприемлемость распространённой практики определения коэффициентов рекомбинаций в низкоразмерных структурах из их объёмных значений.

Работа была поддержана Исследовательским Офисом Армии США (грант No. W911-NF-05-1-0308).

- Zory P.S., Jr. (Ed.) Quantum well lasers (Boston: Academic Press Inc., 1993).
- Coldren L.A., Corzine S.W. Diode lasers and photonic integrated circuits (New York: John Wiley & Sons, 1995).
- Елисеев П.Г., Попов Ю.М. Квантовая электроника, 24 (12), 1067 (1997).
- Alferov Zh.I. Nobel Lecture: The double heterostructure concept and its applications in physics, electronics, and technology. Rev. Mod. Phys., 73 (3), 767 (2001).
- Dingle R., Henry C.H. Quantum effects in heterostructure lasers. U.S. Patent 3982207, Sept. 21, 1976.
- 6. Arakawa Y., Sakaki H. Appl. Phys. Lett., 40 (11), 939 (1982).
- Newell T.C., Bossert D.J., Stintz A., Fuchs B., Malloy K.J., Lester L.F. IEEE Phot. Technol. Lett., 11 (12), 1527 (1999).
- 8. Park G., Shchekin O.B., Huffaker D.L., Deppe D.G. *IEEE Phot. Technol. Lett.*, **13** (3), 230 (2000).
- 9. Shchekin O.B., Deppe D.G. Appl. Phys. Lett., 80 (18), 3277 (2002).
- Semiconductor lasers. E.Kapon (Ed.) (San Diego: Academic Press, 1999)
- 11. Bimberg D., Grundmann M., Ledentsov N.N. *Quantum dot heterostructures* (Chichester: John Wiley & Sons, 1999).
- 12. Blood P. IEEE J. Quantum Electron., 36 (3), 354 (2000).
- Agrawal G.P., Dutta N.K. Long-wavelength semiconductor lasers (New York: Van Nostrand Reinhold Company, 1986).
- 14. Asryan L.V., Suris R.A. Semicond. Sci. Technol., 11 (4), 554 (1996).
- Asryan L.V., Gun'ko N.A., Polkovnikov A.S., Zegrya G.G., Suris R.A., Lau P.-K., Makino T. Semicond. Sci. Technol., 15 (12), 1131 (2000).
- Maximov M.V., Asryan L.V., Shernyakov Yu.M., Tsatsul'nikov A.F., Kaiander I.N., Nikolaev V.V., Kovsh A.R., Mikhrin S.S., Ustinov V.M., Zhukov A.E., Alferov Zh.I., Ledenstov N.N., Bimberg D. IEEE J. Quantum Electron., 37 (5), 676 (2001).
- Asryan L.V., Luryi S., Suris R.A. IEEE J. Quantum Electron., 39 (3), 404 (2003).
- Perea E.H., Mendez E.E., Fonstad C.G. Appl. Phys. Lett., 36 (12), 978 (1980).